

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第171回委員会議事録

1. 日 時： 平成21年2月6日（金） 13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麴町5-1）

3. 出席者：49名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：大杉 健（ジャパンエナジー），響 義則（住友化学），小西信彰（代理：末吉一雄，横河電機），篠原和太郎（東芝），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），瀧野哲郎（東京工業大学），山下善之（東京農工大学），伊藤利昭，梅田富雄（青山学院大学），北島禎二（東京農工大学），木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），関 宏也（東京工業大学），外輪健一郎（徳島大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），濱口孝司（名古屋工業大学），船津公人（東京大学），松本秀行（東京工業大学），矢野智之（名古屋大学），石田敏和（宇部興産），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），大坂 宏（大坂システム計画），川村継夫（オメガシミュレーション），村越俊二（代理：小林隆広，出光興産），小崎恭寿男（日揮），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），坂本英幸（横河電機），中川明浩（代理：畑 利幸，日産化学工業），中西 勤（代理：森下敏治，三菱化学），馬場一嘉（ダイセル化学工業），樋口文孝（出光興産），矢羽田喜彦（三井化学），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），村山 大（東芝），山田幸治（宇部興産），菅野智司（富士電機システムズ）

委員以外の出席者：菊池忠雄（東芝三菱電機産業システム），竹内健史（出光興産），金子弘昌（東京大学），菊池康紀（東京大学），藤咲範男（日立ハイテクトレーディング），浅井弘人（日産化学工業），野口芳和（日揮）

4. 委員会

- 1) 委員長による挨拶
- 2) 次回以降の研究会およびPSE関連会議の案内（資料#1参照）
- 3) 第172回委員会・平成21年度第1回研究会の予告（by 野田委員）
- 4) 本日の研究会スケジュールの説明

資料#1：第171回委員会・平成20年度第5回研究会

以上